

分析機器部門講習会シリーズ

集束イオンビーム走査電子顕微鏡 (FIB/SEM) 講習会のお知らせ

新しく設置しました試料作製の集束イオンビームと形態観察の走査電子顕微鏡を組み合わせたDualBeam装置、Sciosの応用操作を説明します。

日時： 平成28年 2月5日(金) 9:30~12:00
13:30~17:00

使用機器： Scios

受講対象： Sciosを使用の方

講習内容： 応用操作

場所： 医工連携研究室（研究棟3号館 5階 医工連携研究室）

定員： 約4名

申込期間： 平成 27年 2月4日（木）12時まで

申込方法： 電子メールで、「講習会名（FIB/SEM講習会）」 「所属講座名」 「氏名」 「内線番号」 「電子メールアドレス」 を明記の上、
k.itakura@med.nagoya-u.ac.jp 宛にお申込ください。

お問い合わせ先

医学教育研究支援センター 分析機器部門

担当： 板倉 （内線：2395 Email：k.itakura@med.nagoya-u.ac.jp）

※Web でも講習会情報を掲載しています (<http://www.med.nagoya-u.ac.jp/kiki/workshop/index.html>)